DIN EN ISO 3868:1995-01 (D)

Metallische und andere anorganische Schichten - Messung von Schichtdicken - Fizeau-Vielstrahl-Interferenz-Verfahren (ISO 3868:1976); Deutsche Fassung EN ISO 3868:1994

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 2

2 Prinzip 2

3 Definitionen 2
3.1 Okularfadenmikrometer 2
3.2 Einheiten des Fadenmikrometers 2
3.3 Fizeau-Platte 2
3.4 Streifen 2
3.5 Meßlinie 2
3.6 Versatz 2
3.7 Abstand 2

4 Prüfeinrichtung 2

5 Einflüsse auf den Meßwert 2
5.1 Reflektierende Schicht 2
5.2 Stufenform 2 3
5.3 Ablesegenauigkeit 3
5.4 Ebenheit der Oberfläche 3
5.5 Stufenausbildung 4
5.6 Rauheit 4
5.7 Sauberkeit 4
5.8 Herstellung der Stufe 4

6 Kalibrierung 4

7 Durchführung 4
7.1 Herstellung der Stufe 4
7.1.1 Abdeckung vor dem Beschichten 4
7.1.1.1 Vor dem Beschichten ist ein Teil der Oberfläche 4
7.1.1.2 Der nicht abgedeckte Abschnitt der Oberfläche 4
7.1.2 Abdeckung nach dem Beschichten 4
7.1.2.1 Es ist die gesamte beschichtete Oberfläche 4
7.2 Durchführung der Messung 4
7.2.1 Die Objektfokussierung ist einzustellen und die 4
7.2.2 Der Winkel zwischen der Fizeau-Kontaktplatte 4
7.2.5 Die Verschiebung eines Streifens über die Stufe 4

8 Meßunsicherheit 5